

한국과학기술원 NCS 기반 직무기술서 - 연구직(시간제위촉연구원)

| 채용분야 | 시간제 위촉연구원 | 분류체계 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---------------|--|------|------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | 16. 재료 | 02. 세라믹재료 | 00. 세라믹재료 | 01. 세라믹재료품질관 리 |
| | | | 17. 화학·바이오 | 01. 화학물질·화학공정 관리 | 03. 화학제품연구개발 | 02.화학신소재개발 |
| 설립이념 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 한국과학기술원법 - 깊이 있는 이론과 실제적인 응용력으로 국가 산업 발전에 기여할 고급 과학기술 인재 양성 - 국가 정책으로 추진하는 중장기 연구 개발과 국가 과학기술 저력 배양을 위한 기초응용 연구 수행 - 각 분야 연구 기관 및 산업계와 연계한 연구 지원 | | | | | |
| KAIST 주요사업 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육: 과학기술 글로벌 인재 양성 ○ 연구: 인류 난제 해결을 위한 연구 ○ 국제화: 글로벌 리더십 역량 강화 ○ 창업: 창업혁신 생태계 구축 및 발전 | | | | | |
| 성장 동력 | <ul style="list-style-type: none"> ○ Vision : 국가와 인류, 지구를 위한 독특한 빛깔의 세계 10위권 대학 ○ Mission: 인류의 행복과 번영을 실현하는 과학기술혁신대학 ○ QAIST: 창의인재, Post AI 융복합 연구, 글로벌 인재, 기술가치창출, 소통의 신뢰 ○ 3C Spirit : Challenge, Creativity, Caring | | | | | |
| 담당 업무 | <ul style="list-style-type: none"> ○ InP 양자점의 표면 처리 공정 개발을 통한 양자점의 발광 효율 향상 연구 ○ 양자점의 구조적, 광학적 특성 분석 연구 ○ 양자점 표면 및 리간드 특성 분석 연구 | | | | | |
| 직무수행 내용 | <ul style="list-style-type: none"> ○ Hot injection 방법 기반의 InP 양자점 합성 및 표면 처리 공정 개발 ○ UV-Vis 분광광도계, 형광분광기, 투과전자현미경(TEM), X-ray 회절분석기 등을 활용한 나노입자 분석 | | | | | |
| 필요지식 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 나노재료 관련 열역학, 재료과학을 포함하는 전반적인 배경지식 ○ 발광재료 관련 광물리적 배경지식 | | | | | |
| 필요기술 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 고균일, 고분산 InP 양자점 합성 기술 ○ UV-Vis 분광광도계, 형광분광기, 투과전자현미경(TEM), X-ray 회절분석기 사용 및 결과 분석 기술 | | | | | |
| 직무수행태도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구윤리를 준수하며, 안전 및 보안 의식을 겸비하고 적극적인 연구 수행 자세 ○ 창의적이고 도전적이며, 객관적이며 합리적인 업무 태도 | | | | | |
| 직업기초능력 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 의사소통능력, 문제해결능력, 자기개발능력 ○ 대인관계능력, 정보능력, 기술능력 | | | | | |
| 참고사이트 | www.ncs.go.kr, www.kaist.ac.kr | | | | | |